

## TEM 樣品製備要求：

1. 樣品之取放由中心人員操作，使用者請勿自行操作，儲存檔案請自備光碟片。銅網等請用 250 mesh 以上，若有特殊需求欲使用低 mesh 數者，請事先徵求中心人員同意，操作中發現樣品或支持膜破損嚴重或有體積太大之顆粒時，應立即取出樣品，以避免碎片掉落、造成污染。
2. 磁性樣品會造成 TEM 電磁場受干擾而無法恢復正常功能者，本中心拒絕受理。
3. 低熔點樣品 (如銻、錫等)，會產生相變及蒸鍍效應，本中心拒絕受理。
4. 高分子聚合物樣品裂解溫度須達 350°C，並於預約時檢附 TGA 曲線圖。
5. 超薄切片與金屬、陶瓷、奈米線或奈米顆粒等材料樣品請確實進行乾燥並放入乾燥箱保存一天以上，再進行觀察。
6. 細菌、病毒、蛋白質顆粒等之負染色樣品請儘量吸除染劑等溶液，並陰乾 2 小時以上，再進行觀察。
7. 觀察過程中，若樣品在電子束照射下會分解或釋出揮發性氣體，造成影像飄移、無法對焦，應立即取出樣品，以避免污染。
8. 請填寫以下表格：

樣品種類或成分	
樣品製備過程中曾使用的有機溶劑	
試片乾燥方式及乾燥時間 (樣品製備過程中若有加熱，請註明溫度。)	
銅網 mesh 數 預估樣品大小或切片厚度	
染劑種類及染色時間	

使用者簽名：

指導教授或主管簽名：